NOTIFICATION OF REASONS FOR REJECTION

Patent Application No.: 2002-223756

Date of Draft: March 18, 2005 Date of Dispatch: March 29, 2005

Examiner: Masahisa KUNITA 9111 2P00

Patent Attorney: Hiroyasu TAKAHASHI et al.

Applied Article: 2nd para. of Art. 29

This application should be rejected for the reasons set forth below. Should the applicant have any arguments against the reasons, such arguments should be submitted within 60 days from the date of dispatch of this notification.

REASONS

The inventions in the following claims of the present application should not be granted a patent under the provision of 2nd para., Art. 29 of the Patent Law since it would have been obvious for those who have common knowledge in the art to make the inventions prior to the filing date of the present application on the basis of the inventions that had been described in the following publications distributed in Japan or foreign countries, or the inventions that had been available to public through telecommunications network system.

NOTE

Claims: 1 to 12

Reference 1: JP-A-H11-111423 (See, in particular, paragraphs [0040] to [0047].)

Reference 2: JP-A-S64-004275 (See, in particular, line 20, page 5.)

Reference 3: JP-A-S59-179347 (See, in particular, lines 8 to 9, upper right column of page 2.)

Reference 1 is appreciated to describe a printer comprising an engraving roller (engraving roller 200) having a engraved plate, a transfer roller (transfer roller 300) having a transfer surface, an ink feed nozzle (paste feeder 101), and a scraping blade (paste scraping means 500).

In Reference 1, although no mention is made of the depth of the engraved plate which constitutes the printing plate, in light of the descriptions in References 2 and 3, a skilled artisan could have set the depth of an engraved plate to be 15-20 μm which is appreciated to be a numerical value range that could have been employed based on common sense.

Further, the matters recited in claims 2 to 12 of the present application are

not appreciated to be tl	e ones that should be paid particular attention.
	RESULTS OF PRIOR ART SEARCH
Field of search	IPC 7th edition
	B41F17/22
	H01T21/02
Prior Art Reference The results of trejection.	nis prior art search on record do not constitute the reasons for
<u> </u>	uestion about this notification of reasons for rejection, or if an be conducted, please contact the person named below.
	Patent Examination Printer ahisa KUNITA

FAX 03-3580-6902

拒絕理由通知書

特許出願の番号

特願2002-223756

起案日

平成17年 3月18日

特許庁審查官

國田 正久

9111 2P00

特許出願人代理人

高橋 祥泰(外 1名) 様

適用条文

第29条第2項

期限5月28日

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において 頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用 可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における 通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法 第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記

請求項1-12

引例1:特開平11-111423号公報(特に【0040】-【0047

】参照)

引例2:特開昭64-4275号公報(特に5頁20行参照)

引例3:特開昭59-179347号公報(特に2頁右上欄8-9行参照)

引例1には、印刷用凹版を有する刻印ローラー(刻印ローラ200)と、転写面を有する転写ローラー(転写ローラ300)と、インク供給ノズル(ペースト供給部101)と、掻き取りブレード(ペーストかき取り手段500)とを有した印刷装置が記載されているものと認める。

ここで、引例 1 には、印刷用凹版を構成する凹版の深さについての言及はないが、引例 2 、3 の記載からみて、凹版の深さを 1 5 ~ 2 0 μ m ν とすることは、当業者が常識的に採用し得る数値範囲と認める。

また、本願請求項2-12記載の事項も格別のものとは認められない。

先行技術文献調査結果の記録

B41F17/22 H01T21/02

· 先行技術文献

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、または面接のご希望がございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第一部 印刷・プリンター 國田正久 TEL (03)3581-1101 内線 3261 FAX (03)3580-6902

9日本国特許庁(JP)

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-4275

@Int_Cl_*	識別記号	庁内整理番号	43公開	昭和64年(1989)1月9日
B 05 C 1/02 11/10	102	7258-4F 6804-4F		
B 41 F 17/14 H 01 L 21/31	4	E-6612-2C 6708-5F 審査請求	未請求	発明の数 1 (全9頁)

⑤発明の名称 薄膜形成装置

> 创特 昭62-160464

御出 願 昭62(1987)6月26日

康広

京都府京都市中京区壬生花井町3番地。日本写真印刷株式

明者 面 明

京都府京都市中京区壬生花井町3番地 日本写真印刷株式

会社内

日本写真印刷株式会社

京都府京都市中京区壬生花井町 3 番地

1. 発明の名称 薄膜形成装置

2. 特許請求の範囲

(1)多数の凹部(11)を有する凹版(10)と、こ の凹版(10)に供給されたインキを前記凹部(11)に 充填するドクター(31)を有する薄膜形成装置にお いて、前記凹版(10)の凹部の内盤部の表面および 土手部の表面が少なくともセラミックであり、ド クター(31)の一部を構成するドクタープレード(3 2)の刃先が少なくともプラスチックであることを 特徴とする薄膜形成装置。

- (2) ドクターブレード (32) 全体がアラスチ ックである特許請求の範囲第1項に記載の薄膜形 成装置。
- (3) プラスチックがポリプロピレンまたはポ リエチレンテレフタレートあるいはポリエチレン である特許請求の範囲第1項または第2項に記載 の薄膜形成装置。
 - (4)凹版(10)が平板状である特許請求の範囲

第1~3項のいずれかに記載の薄膜形成装置。

- (5) 凹版(10)がシリンダー状である特許論文 の範囲第1~3項のいずれかに記載の薄膜形成装
- (6) 凹版(10)に供給されたインキを被印刷体 (3)に転移する、弾性を有する凸版(5)が表面に形 成された印刷ロール (4)を有する特許請求の範囲第 5 項に記載の薄膜形成装置。
- (7)セラミックがコーティングによって形成 されたものである特許請求の範囲第1~6項のい ずれかに記載の薄膜形成装置。
- (8) セラミックが溶射によって形成されたも のである特許請求の範囲第1~6項のいずれかに 記載の薄膜形成装置。
- (9)セラミックが無機窒化物である特許請求 の範囲第7~8項のいずれかに記載の薄膜形成装 置。
- (10) セラミックが無機炭化物である特許請求 の範囲第7~8項のいずれかに記載の淳脱形成装

(11) セラミックが無機酸化物または複合酸化 物である特許請求の範囲第7~8項のいずれかに 記載の薄膜形成装置。

(12) セラミックの厚みがO.1μm~10μmであ る特許請求の範囲第1~11項のいずれかに記載の 薄膜形成装置,

(13) セラミックが、反応性スパッタリング法 あるいは反応性イオンアレーティング法・アラズ マCVD法などの比較的低温によって形成された 特許請求の範囲第1~12項のいずれかに記載の薄 膜形成装置.

(14) 溶射によって形成されたセラミックの厚 みが50μ m ~ 500μ m である特許請求の範囲第8~ 11項のいずれかに記載の薄膜形成装置。

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

この発明は、金属イオンの溶出および金属粉の 混入を防止する薄膜形成装置に関する。

く従来の技術>

從来、半導体素子の絶縁被膜や液晶表示素子の

上記所定パターンの薄膜を形成するようにしたも のである。

ここに用いられる凹版は、支持体が鉄板であり、 その表面に電解メッキなどの方法により網メッキ が施され、表面研磨が行われたのちにフォトリソ 工程にて所定パターンが加工され、そののち硬度 を増すために硬質クロムメッキが施されている。 前記以外の構造のものとしては、たとえば圧延網。 を表面研磨後前記と同様の手法により凹版に所定 パターン加工が施されたもの、あるいは、ステン レス板に所定パターンが加工されたものなどがあ

一方、ドクターブレードに関しては、通常ステ ン鋼製ドクターが用いられている。

<発明が解決しようとする問題点>

応性に富んだ添加剤などを含有した各種のインキ が増加している。

しかし、インキが凹版と接触している場合、さ

配向膜・絶縁被膜・液晶パネルのシール材・源電 被膜など、種々の電子部品関連の機能性薄膜を形 成するには、実開昭58-170864号に提示されたよう な薄膜形成装置を用いていた。

この薄膜形成装置は、所定パターンに配列され た多数のインキセル(またはグループス)を有す・ る平板状凹版と被印刷体とを基台上に並べて戴置 する一方、凹版の近傍に数10~30,000c.p.s.の粘 度を有する高分子溶液からなるインキを凹版のイ ンキセルに充填するインキ供給装置と印刷ロール とを有する印刷ロール支持枠を基台に凹版と被印 刷体との間で移動自在に備えるとともに、印刷ロ ール支持枠にドクターを備えている。この薄膜形 成装置においては、インキを凹版のインキセルに 供給してドクターで余分なインキをかき落とした 後、印刷ロールを凹版に圧接させつつ回転させて、 印刷ロールの合成樹脂製の柔らかい凸部の表面に 上記凹版のインキセルのインキを所定パターンに 付着させ、インキが付着した印刷ロールを回転さ せつつ凸部のインキを被印刷体の表面に印刷して

らに詳しくは、薄膜形成装置の機構上、インキと 凹版との接触面積が大きい場合、凹版の下地であ る金属層とインキとの反応が問題となる。たとえ は、インキが液晶配向膜用の高分子溶液であるボ リイミドの場合、ポリイミド中のレジン自身が有 する窒素元素あるいは主希釈溶剤のNMP自身が 有している窒素元素が添加剤などにより凹版から 溶出した金属イオンと錯イオンを形成し、形成さ れた薄膜中に金属が残存し、その薄膜特性に著し く影響を与える危険性があった。これは、凹版に 施される硬質クロムメッキは、内部応力により生 するクラックやメッキ被膜形成過程に生じるピン ホールをメッキ被膜内部に有するものであるから

一方、凹版とドクターブレードとの摩擦によっ 最近、染料・顔料を含有したインキ以外に、反 が薄膜中に混入することもある。その金属の種類 としては、凹版やドクターブレードを構成する鉄 ・クロム・ニッケルなどが考えられる。また、金 風粉中に銅イオンが含まれることもある。これは、





凹版上のクロムメッキ層が形成される際にメッキ・ 浴が銅イオンによって汚染されている場合、この クロムメッキ暦が摩耗した場合、銅イオンが溶出 することになる。

また、不規則に摩耗したドクターあるいは凹版。 を用いることによって、形成された薄膜の表面に 荒れなどが生じることもある。

したがって、この発明の目的は、上記のような 同題を解決することにあって、金属イオンの溶出 することにある。

<問題点を解決するための手段>

上記目的を達成するために、この発明は、凹版 をセラミックで、ドクターブレードの刃先の表面 をアラスチックで構成するようにした。すなわち、 この発明は、多数の凹部を有する凹版と、この凹 版に供給されたインキを前記凹部に充填するドク ターを有する薄膜形成装置において、前記凹版の 凹部の内壁部の表面および土手部の表面が少なく ともセラミックであり、ドクターの一部を構成す

…… を登えた後、レーザーにより彫刻を施しパターン を形成したものを用いてもよい(第3図参照)。 あるいは、基材全体をセラミックで構成し、グリ ーンの状態でプレスして焼結するか、射出して金 型成形を行うなどしてセルを形成したものでもよ い、また、凹版10の形状としては、平板状のも のでもシリンダー状のものでもよい。

> 前記セラミックコーティングは、少なくとも凹 版10の表面、つまりインキの接触する部分に施 される。

セラミックとしては、無機窒化物・無機炭化物 ・無機酸化物・複合酸化物などを用いる。

無概窒化物としては、窒化ケイ素(SiaNa)・窒化 チタン(TiN)・窒化アルミニウム(AIN)・窒化ホウ 素(BN)などを用いるとよい。無機炭化物としては、 炭化クロム(Cr-C)・炭化ケイ素(SiC)・炭化チタン (TiC)などを用いるとよい。無機酸化物としては、 ∵酸化アルミニウム(Al₂O₂)・酸化ケイ素(SiO₂)・酸 化チタン(TiO2)などを用いるとよい。複合酸化物。 としては、ムライト(3A120g·2Si0a)・ベタライト

るドクターブレードの刃先が少なくともプラスチ ックであるように構成したものである。

この発明について図面を参照しながらさらに詳 しく説明する.

第1図はこの発明の薄膜形成装置の一実施例を 示す斜視図、第2~3図はこの発明の凹版の一実 ` 植例を示す断面図、第4図はこの発明のドクター ブレードの一実施例を示す断面図である。3は被 印刷体、4は印刷ロール、5は凸版、10は凹版、 と金属粉の混入とを防止する薄膜形成装置を提供 11は凹部、31はドクター、32はドクターブ プ**レードである。** デジュ ミージャッシュ

> ▽凹版10としては、凹版10の電解網層に所定 ... パターンが形成され、その上に硬質クロムメッキ が厚さ1μm~数μm値されたもの、あるいは前 記電解網閥上にニッケルメッキが1~数μπ施さ れたもの、あるいはステンレス板(厚さ0.5mm~数 cm)に、前述と同様の所定パターンが形成された - ものを基材として、その上にセラミックコーティ ングが施されたものである(第2図参照)。また、 前記基材にセラミックを溶射し、研磨により表面

(Li₂0·SiO₂·Al₂O₃) · フォルステライト (2MgO・ SiOz)・ジルコン(ZrSiO4)などを用いるとよい。

これらの無機化合物は、耐摩耗性、特に滑り厚 接性に優れ、かつ熱衝撃性・耐薬品性に優れてい る。電気絶縁性に関しても、たとえば酸化アルミ ニウム (Al₂0₃) は10¹¹Ω·cm、また窒化ケイ素 (Si₃N₄)は10¹³Ω·cmの比抵抗を有している。

四版10にセラミックをコーティングする方法 としては、反応性スパッタリング法・反応性イオ ンプレーティング法などのiP.V.D法、あるいは低 温CVD法・プラズマCVD法などがある。イオ ンプレーティング法に関しては、低温(200℃前後) で順厚ムラの少ないマルチアーク放電式イオンア レーティングなどの使用が可能である。低温での イオンプレーティング、あるいは低温でのスパッ タリングによって得られた無機化合物被膜は、密 着強度に関しても、コーティングムラに関しても 同題はない。

セラミックの被膜の厚さに関しては、凹版10 において0.1μm~10μm、望ましくは1.0μm~

特開昭 64-4275 (4)

5.0μmが適切である。セラミック膜厚が薄い場合。 たとえば、0.1µmより薄い場合は下地層の硬度が一 そのままコーティング表面の硬度に反映する。一 方、厚さが10μmを越える場合、凹版 1 O に加工 された所定パターンの形状および深度に悪影響を 及ぼし、必然的に膜厚ムラも顕著となる。通常、 厚さが1μm以上であれば、セラミック自身の硬 度、たとえば壁化チタン (TiN) の場合、その硬度 は1.900~2.400Hvが得られる。

前記セラミックの溶射は、プラズマを利用した ものなどで、鉄の基材に直接被膜を形成した後、 その表面を研磨により整える。その被膜の厚みは 100~500μmであり、その後レーザー光により所 定のパターンのセルを彫刻する。 and the second of

以下に各種セラミック被膜の物性を示す。

炭化チタン(TiC)

硬さ 3.300~4.000VHN

~ 3.160℃ 溶融点

4.92g/cm³ 熱 閲 張 係 数 (200~400℃) 7.8×10-6/℃ 27 . . .

電気抵抗(20℃)

85Ω

弾性率...

 $4.48 \times 10^4 \text{kg/mm}^2$

摩擦係数

 0.25μ 4~8 µ m

適正被覆厚さ 炭化クロム (Cr-C)

1,900~2,200VHN

溶融点 ...

1,780℃

密度

弹性率

6.68g/cm3

熟 財 張 係 数 (200~400℃) 10.3×10⁻6/℃

 $3.80 \times 10^4 \text{kg/m}^2$

1.900~2.400VHN

電気抵抗(20℃)

750

度据係数 …

0:79 u

適正被覆厚さ

8~12 µ m

窒化チタン (TiN)

硬さ

溶融点 2.950°C

- 5.43g/cm³ 密度

電気抵抗(20℃) - - ※ ----- 22Ω --

 $2.56 \times 10^4 \text{kg/ms}^2$ 强件率

熟 財 張 係 数 (200~400℃) 8.3×10⁻6/℃

摩擦係数

0.49 11

適正被獲厚さ

4~8 µ m

酸化アルミニウム (AlaOa)

硬さ

2.200~2.600VHN

溶融点 密度

2.040℃

熟회張係数(200~400℃) 7.7×10-6/℃

3.98g/cm³

電気抵抗(20℃)

1014Ω

弹性率

 $3.90 \times 10^4 \text{kg/mm}^2$

摩擦係数

0.15μ

適正被預度さ

1~3 µ-m

なお、凹版 1/0 は、全体が前記の酸化アルミニ ウム (Al 203) や 酸 化 ケイ素 (SiO 2) な ど の 無 機 酸 化物もしくは無機窒化物など、あるいはムライト ・ジルコンコーディライト・フォルステライト・ ステアタイト・コーディライトなどとの複合セラー、キを被印刷体3表面に転移させる。 ミックからなるものであってもよい. .

ドクタープレード32としては、ポリプロピレ ン・ポリエチレンテレフタレート・ポリエチレン など耐溶剤性を有する材質を薄板状に形成し、刃

先を研磨仕上げしたものである (第4図参照)。

なお、この発明の薄膜形成装置は、凹版10上 のインキを直接被印刷体3に転移するような構成 にしてもよいし、四版10上のインキを一旦印刷 ロール4表面に転移させ、その後被印刷体4に転 移するような構成にしてもよい。

印刷ロール4はその表面が弾力性を有する凸版 5が形成されている。凸版5の材質としては、た とえばブチルゴムなどのゴム系、あるいはナイロ ン系樹脂などの合成樹脂、または感光性ゴム・感 光性樹脂などを用いることができる。印刷ロール 4 は凹版10と所定の圧力で接触して、印刷ロー ル4の凸版5に凹版10の凹部11のインキを転 移し、さらに印刷ロール4と被印刷体3とを所定 の圧力で接触して印刷ロール4の凸版5上のイン

以下に、この発明の薄膜形成装置の実施例を図 面に基づいて詳細に説明する。

- 実施例の薄膜形成装置は、第1図に示すように、





基白1の支持枠2に、凹版10とインキ供給手段 20と庭色手段30と印刷ロール4とが各々支持 され、次のように構成されている。印刷ロール駆 動手段60の駆動、すなわち印刷ロール駆動モー ター61の駆動により印刷ロール4と凹版10と を同期回転させる。インキ供給手段20からイン キを凹版10に供給して展色手段30で余分なイ ンキを掻き落し、凹部11内にインキを充填させ る。一方、上記支持枠2の下方の基白1上に、被 印刷体3を載置したガラス板などの閉性板からな る定盤41を移動可能に配置して定盤駆動手段5 0の駆動、すなわち被印刷体駆動モーター51の 駆動によりポールネジ52を回転させることによっ - り、定塁41に載置された被印刷体3を被印刷体 搬入位置Bから印刷位置Aへと移動させる。イン キを充填させた上記凹版10から印刷ロール4に 所定パターンのインキを転移させた後、印刷ロー ル4を印刷位置Aにおいて被印刷体3の表面に接 触させ、該被印刷体3に所定パターンの薄膜を印 刷形成する。その後、定盤41は定盤駆動手段5

0の駆動により被印刷体搬出位置Cへと移動し、そこで被印刷体3が排出される。この同、上記凹版10の回転と上記定盤41の移動とは駆動制御手段70によって制御されている。次いで、定盤41は高さ調節手段(図示せず)によって降下し、定盤駆動手段50の駆動により逆に被印刷体搬出位置Cから印刷位置Aを通って被印刷体搬入位置Bへと移動する。

上記支持枠2は一対の支持板からなり、長方形台からなる蓋台1の中央部所定位置に配置されている。この支持枠2の上部において、凹版10が回転自在に支持され、その凹版10の上方にインキ供給手段20と展色手段30とが配置されている。また、凹版10の下方には印刷ロールが回転自在に支持されている。

上記凹版10は、回転輸12に肩部13が固定されてなり、この肩部13上に凹版10が形成されている。凹版10としては、支持体が鉄板であり、その表面に電解メッキにより絹メッキが施され、その表面に深度5~50μm・ビッチ0.1~0.5

■■のパターンが施され、さらに無電解メッキにより厚さ4μm±0.5μmのニッケルがコーティングされ、さらにアーク放電式イオンプレーティング法によって窒化チタン(TiN)が厚さ3~4μmコーティングされたものを使用した。上記凹版10の回転軸12は両端が支持枠2に回転自在に支持される。支持枠2から外方に突出した回転軸12の端は、第1ギヤ8を固定し、回転軸で支持された原部が上記印刷ロールの胸部の凸部に一定の圧力で接触する。

インキ供給手段20は、インキ供給体21とインキノズル22と一対の案内レール23とからなる。インキ供給体21は、支持枠2の上部に架設された一対の案内レール23に沿って左右に移動することができるように構成されている。また、インキ供給体21からインキノズル22が凹版10の表面上方に延びている。このインキノズル22は、凹版10の凹部11中にインキが留まる時間を短くしてインキの乾燥を防止するため凹版10と被印刷体3との接触位置にできるだけ近い位

置に設けられる。上記インキ供給体21は、図示しないワイヤーなどを介してモーターまたはエアシリンダーなどの駆動により、上記案内レール23沿いに移動して、凹版10の表面上にインキを連続的に供給する。なお、このインキは、合成問題または樹脂前駆体および海剤の混合物などからなり、高粘度のもののみでなく低粘度のものまで適用が可能である。

展色手段30は、ドクター31と、その先端に取り付けられ凹版10の表面に接触させられるドクターブレード32とから構成されている。このドクター31およびドクターブレード32は、図示しないエアシリンダーの駆動により凹版10に接触する位置と凹版10から待避する位置と凹版10から待避する位置と凹版10から待避する位置と凹版10から行って、凹版10の表面に接触して、凹版10の表面上に落との凹たインキを該表面沿いに広げて、凹版10の凹部11内に一定量のインキを充填させるようにする。ドクターブレード32としては、ポリエチレ

ン製刃付ドクターを使用した。

印刷ロール4は、その回転軸に胴部が固定され、 この調部周囲面の所定箇所には、たとえば、ブチ ルゴムなどのゴムまたはナイロン系樹脂などの合 成樹脂あるいは感光性ゴムもしくは感光性樹脂な どからなる軟質製品部5を備えて、この凸部5に 上記凹版10所定パターンのインキを転移する。 上記回転軸はその両端が支持板に回転自在に支持 され、該回転軸の支持枠2の上記一方の支持板か ら外方に突出した一端に第2ギヤ9を固定して、 該第2ギヤタと上記第1ギヤ8とをかみ合わせる。 上記回転軸の印刷ロール4の他方の支持枠の上記 他方の支持板から外方に突出した他端には上記印 剧ロール駆動モーター61からなる印刷ロール駆 動手段60に連結されている。したがって、この 印刷ロール駆動モーター61が回転駆動すると、 上記第2ギヤと上記第1ギヤとのかみ合いにより 凹版10が印刷ロール4と同期回転する。

被印刷体裁置手段40は基台1上に設けられ、 定盤41と弾性体42と案内レール43とから構

る。次いで、定盤41は高さ調節手段(図示せず)によって降下し、定盤駆動手段50により逆に被印刷体搬出位置Cから被印刷体搬入位置Bへと移動する。この装置によれば、被印刷体搬入位置Bと被印刷体搬出位置Cとが別の箇所に設けられているので、被印刷体3の搬入・搬出作業を円滑に行うことができる。

上記印刷ロール駆動モーター61と定盤駆動モーター51とは駆動制御手段70で制御されて、 凹版10の回転と定盤41の移動とを制御部71か ちが指令パルス出力部72に出力・73は間部のでは、 を一ター61のポジショット73はに対してルカコンユニット73はに対してカーが出力では、 を一ター61のポジションスト73はに対しておいたでは、 に付けーポアンプラ・76に対しているでは、 とこれを取動して、印刷ロール4を所定角度

成されている。基台1上に、被印刷体搬入位置B と印刷位置Aと被印刷体搬出位置Cの間を連続的 に結ぶ一対の案内レール43が固定されている。 この案内レール43上に定盤41が移動可能に設 けられている。定盤41は、定盤駆動手段50の 駆動により被印刷体搬入位置Bから印刷位置Aを 通って被印刷体搬出位置Cへと移動することがで きる。つまり、定盤41に連結された定盤駆動モ ーター51の駆動によりボールネジ52が正逆回 転し、定盤41が上記案内レール43沿いに基白 - 1上で移動する。このとき、定盤41は、上記高 さ調節手段(図示せず)によって、定盤41上の 被印刷体3の表面が凹版10の下面と接触可能な 高さに設定されている。したがって、定盤41が 印刷位置Aに位置するとき、定盤41上に戴置し た被印刷体3が印刷ロール4に接触し、印刷ロー ル4の所定パターンのインキを被印刷体3上に転 移させて薄膜を印刷・形成する。その後、定盤4 11 は定感駆動手段50の駆動により被印刷体機出 位置Cへと移動し、そこで被印刷体3が排出され

上記の構成によれば、第6a図に示すように所定パターンに配列された多数の凹部11を有する凹版10の表面に、インキノズル22からインキを落とし、印刷ロール駅動モーターの回転駆動により、印刷ロールの第2ギヤ9と第1ギヤ8とがかみ合って、凹版10が上記印刷ロールと同期回

転し、ドクターブレード32を用いて凹版10の 表面にインキを広げて凹部11にインキを充填し (第6日図参照)、凹版10が回転してその所定 パターンのインキセルが印刷ロールの凸部5に接 触すると、該凸部5が若干たわみながら凹版10 の所定パターンのインキセルを形成した部分に接 触し、上記凸部5に凹版10のインキセル内のイ ンキを転移させる。次いで、第6c図に示すよう。 に印刷ロール4の凸部5に所定パターンのインキ を全部転移させたのち、印刷ロール4の回転によ り、その凸部5が葢白側に臨むようになったとき、 駆動手段70の制御により定盤駆動モーター51 を駆動してボールネジ52を回転させ定盤41を 被印刷体搬入位置Bから印刷位置Aまで移動させ、 る(第6d図参照)。インキノズル22からイン キを凹版10の表面上に落とした後、次いで、印 刷ロール4の凸部5と被印刷体3との位置決めを したのち、定盤41と凹版10とが繰り返し同一 面が接触するよう印刷ロール駆動モーター61と 定盤駆動モーター51とを、駆動制御手段70に

連続1,000回印刷したのち凹版10上の荒れを観察したところ、ドクターブレード32による荒れ(縦スジ)はほとんど観察されなかった。凹版10表面においても縦スジもほとんど観察されなかった。

く発明の効果>

この発明は次のような優れた効果を有する.

より同期駆動させ、印刷ロール4を回転させつつ 被印刷体3を撤出位置C側に移動させて印刷ロー ル4の凸部5を若干たわませつつ被印刷体3の表 面に接触させ、凸部5の所定パターンのインキを 被印刷体3上に転移させ、薄膜が形成される(第 6 e 図参照)。被印刷体3に所定パターンのイン キが印刷されると、定整駆動モーター51の駆動 によりポールネジ52を回転させて定盤41を被 印刷体排出位置Cに位置させ、被印刷体3を定盤 41上から排出する。この間、凹版10は次の印 刷に備えて所定の位置まで回転して停止する(第 61 図参照)。一方、被印刷体3が取り出された 定盤41は、上記高さ調節手段(図示せず)によ って降下させられ、印刷ロール4と接触しないよ うにして、被印刷体排出位置Cから被印刷体搬入 位置Bまで移動する。そして、定盤41上には次 の被印刷体3が載置させられる。

この装置を用いてポリイミド溶液(樹脂分7.5%、 粘度80c.p.s. / 東レSP-710)をガラス板に厚さ10 0nmでコーティングした。

凹版の表面がセラミックであり、ドクターブレードの少なくとも刃先がアラスチックであるので、 この装置によって形成される薄膜中に金属イオン が溶出せず、また金属粉の混入も生じない。

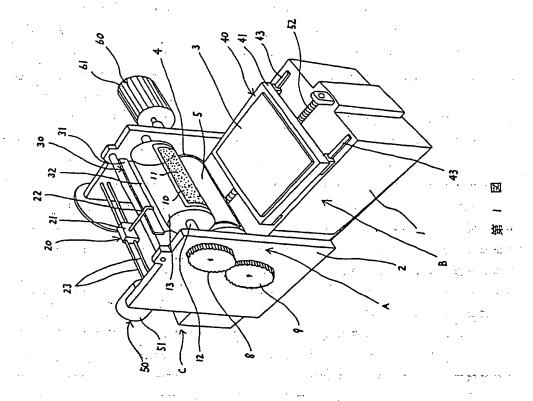
また、凹版およびドクターブレードは化学的に 安定であるので、この装置に用いることのできる インキの選択範囲が拡大する。

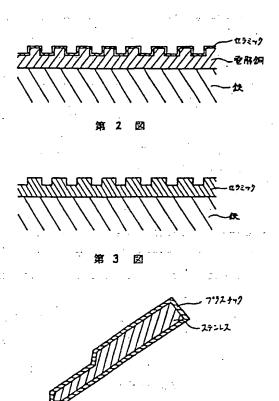
4. 図面の簡単な説明

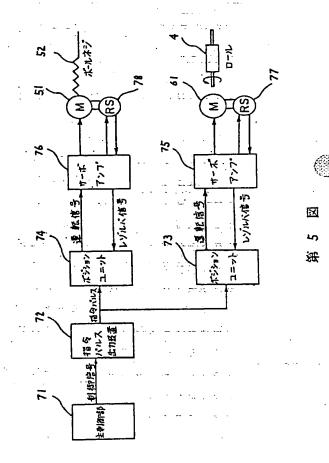
第1図はこの発明の薄膜形成装置の一実施例を示す斜視図、第2~3図はこの発明の凹版の一実施例を示す断面図、第4図はこの発明のドクターブレードの一実施例を示す断面図、第5図は駆動制御手段のブロック図、第6a~f図は薄膜形成工程を示す説明図である。

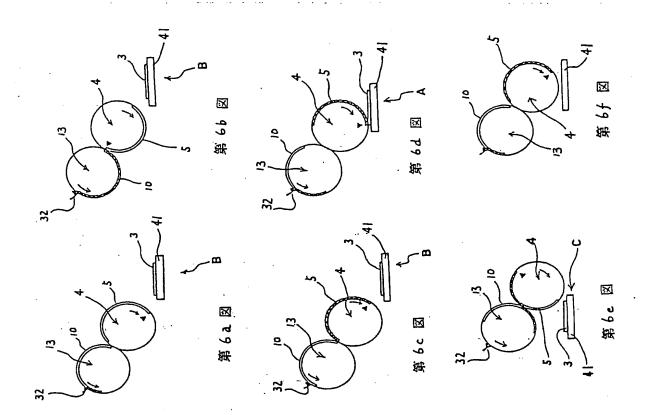
3…被印刷体、4…印刷ロール、5…凸版、1 0…凹版、11…凹部、31…ドクター、32… ドクターブレード。

特許出願人 日本写真印刷株式会社









This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER•

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.